

## 第 75 回日本顕微鏡学会参加報告

共通機器部門 前田誠

### 1. はじめに(目的等)

顕微鏡学会には、大学・研究所・企業等、で電子顕微鏡を用いてあらゆる分野で研究・開発を行っている人達が参加している。最新装置の紹介、新しい分析法、様々な材料・生物の観察・解析等、発表内容は実に多岐に渡る。電子顕微鏡に関する広範囲の情報収集のために参加した。

### 2. 期間・場所

期間： 令和 1 年 6 月 17 日 (月) ~6 月 19 日 (水)

場所： 名古屋国際会議場

### 3. 参加者等

大学・研究所等に所属する研究者、電子顕微鏡もしくはその周辺機器を扱っているメーカー社員 約 800 名以上

### 4. 具体的な参加内容

17 日 (月) : A 会場にて「SEM」に関する発表を聴講。

18 日 (火) : E 会場にて「分析電顕・状態分析等 1, 2」に関する発表を聴講。

19 日 (水) : H 会場にて、「その場観察・環境制御 1, 2」に関する発表を聴講。

### 5. まとめと感想

昨年同様、機械学習を利用した画像解析に関する発表が多くみられた。生物分野での研究例は生体内の組織を自動で塗り分けるプログラムが紹介されていた。それに対して、無機系の試料に適用した研究例は少ないと感じた。しかし、技術の進歩と共に今後無機系試料に対しても積極的に活用されることが予測されるため、今後もこの分野の研究を注視していきたく思った。さらに、機械学習の利用は画像解析だけでなく、EELS(電子線エネルギー損失スペクトル)などのスペクトルデータの解析にも利用されており、今後ますますその重要性が高くなるだろうと感じた。